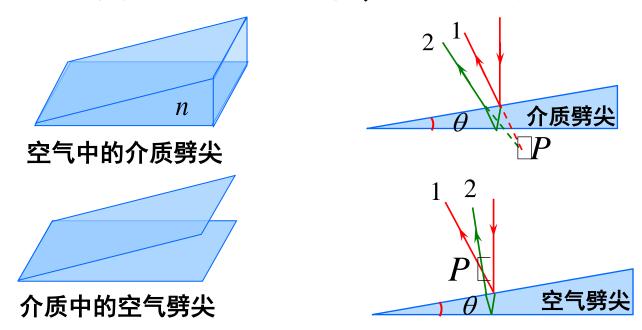
17.4 薄膜的等厚干涉

一、劈尖干涉

1、劈尖干涉装置

劈尖: 指薄膜两表面互不平行, 且成很小夹角的劈形膜。



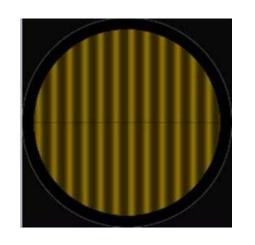
劈尖干涉条纹定域在薄膜表面附近

1010101001011911

2、劈尖干涉光程差分析

平行光垂直入射 $i \approx 0$

$$\theta$$
很小 $n < n_1$ n_1 n_1 n_1



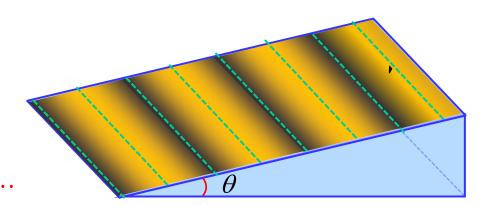
$$\delta = 2n_2 e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3 \dots & \mathbf{明条纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, 3 \dots & \mathbf{暗条纹} \end{cases}$$

3、劈尖干涉图样分析

(1) 明纹中心处劈尖厚度

$$2ne_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$e_k = (2k - 1)\frac{\lambda}{4n} \quad k = 1, 2 \cdots$$



(2) 暗纹中心处劈尖厚度

$$2ne_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$
 $e_k = k\frac{\lambda}{2n}$ $k = 0, 1, 2 \cdots$

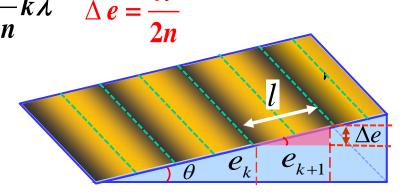
空气劈尖: 棱边处 e=0 为暗条纹

(3) 相邻明或暗条纹中心对应的厚度差 相等

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{1}{2n}(k+1)\lambda - \frac{1}{2n}k\lambda$$
 $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$

每移动1个条纹,

膜厚度改变 $\frac{\lambda}{2n}$



(4) 条纹间距相等,疏密程度与 θ 有关

$$\Delta e = l \sin \theta = \frac{\lambda}{2n}$$

$$l = \frac{\lambda}{2n \sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta} \qquad \theta < 1^{\circ}$$

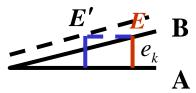


劈尖干涉条纹的动态变化问题

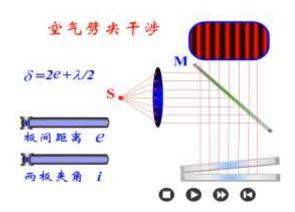


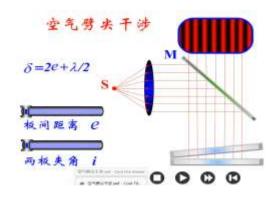


条纹间距变小 向棱边方向移动



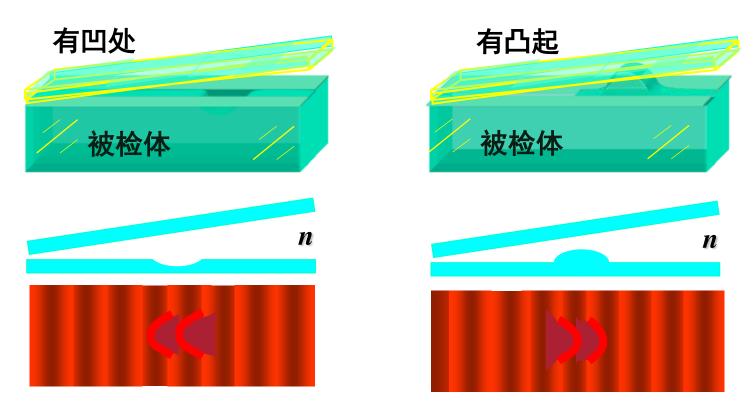
条纹间距不变 向棱边方向移动





二、劈尖干涉的应用

1、检查表面平整度



由平板玻璃和某工件之间形成空气劈尖,若600nm单色 光垂直照射时,观测到劈尖的等厚干涉明条纹如图,若P与

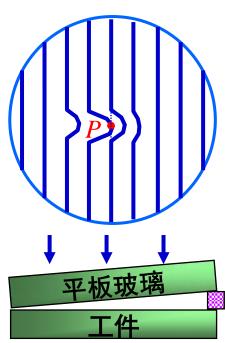
相邻明纹相切,工件表面P点对应处是()

A 凸起的,最大高度为600nm

○ 凸起的,最大高度为300nm

C 凹陷的,最大深度为600nm

D凹陷的,最大深度为300nm

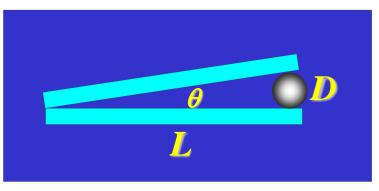


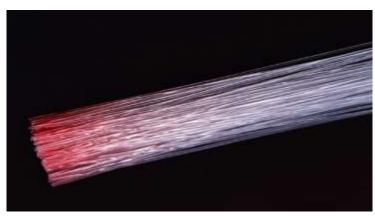
2、测量细丝、薄片厚度

$$\frac{D}{L} = \tan \theta \approx \theta$$

$$l \approx \frac{\lambda}{2\theta} \quad \theta \approx \frac{\lambda}{2l}$$

$$\frac{D}{L} = \frac{\lambda}{2l} \quad D = \frac{\lambda}{2l} L$$





2023年6月,我国实现508公里光纤量子通信

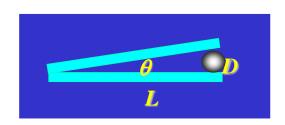
实例分析

将光纤夹在介质板中构成空气劈尖,用波长为 $\lambda = 589.3$ nm的激光照射劈尖,测得光纤距劈尖顶点 L=28.880mm,第1条明纹到第31条明纹的距离为 4.295mm,求光纤的直径。

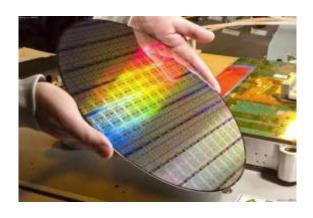
分析: 相邻明纹间距:

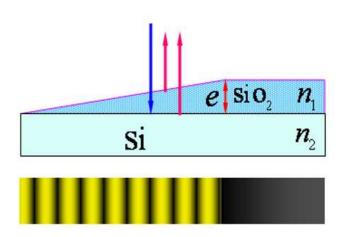
$$l = \frac{4.295}{30} = 0.14317 \, \text{mm}$$

$$D = L \tan \theta \approx L\theta = \frac{L\lambda}{2l}$$
$$= 5.944 \times 10^{-5} \text{ m}$$









测Si表面SiO₂薄膜的厚度,已知Si的折射率为3.42,SiO₂的折射率为1.5,用氦氖激光(λ =632.8nm)垂直照射,在反射光中观察到在腐蚀区域内有6条暗纹,其中A端为暗纹,求SiO₂薄膜的厚度。

分析:
$$n_1 < n_2 < n_3$$
 $\delta = 2n_2 e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

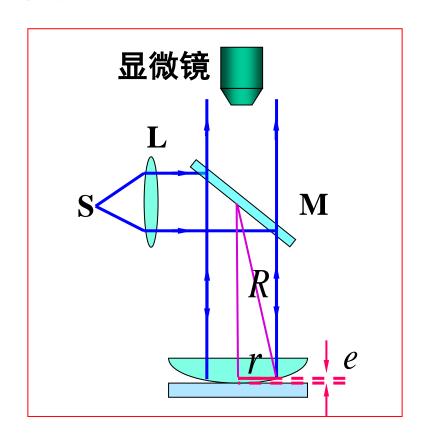
k=0,1,2,3,4,5 k=5 为A点的暗纹

$$e_A = \frac{(2k+1)\lambda}{4n_2} = \frac{11\lambda}{4n_2} = 1160(\text{nm})$$

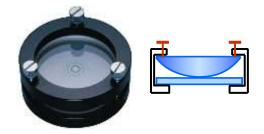
$$n_1=1.00A$$
 $n_2=1.5$
 $n_3=3.42$

三、牛顿环干涉

1、牛顿环装置







2、牛顿环干涉光程差分析

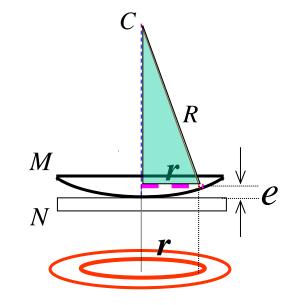
$$\delta = 2n_2 e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3 \cdots$$
 明环
$$(2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \cdots$$
 暗环

$$r^2 = R^2 - (R - e)^2$$
$$= 2Re - e^2$$

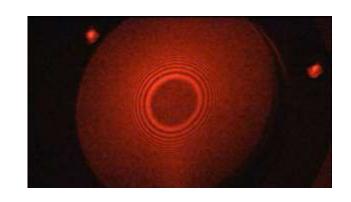
$$\therefore e = \frac{r^2}{2R}$$

$$k = 1, 2, 3 \cdots$$
 明环

$$k = 0, 1, 2, \cdots$$
 暗环



- 3、牛顿环图样分析
 - (1)条纹形状:同心圆环相同的 e 对应同一级条纹空气膜中心处 (e =0) 为暗纹



(2) 条纹疏密: 内疏外密

$$r_{k+1} - r_k = (\sqrt{(k+1)} - \sqrt{k})\sqrt{R\lambda/n}$$

干涉级越高,环间距越小 间距随n λ 变

(3) 条纹级次: 内低外高 r 越大, 干涉级越高



牛顿环干涉动态变化问题

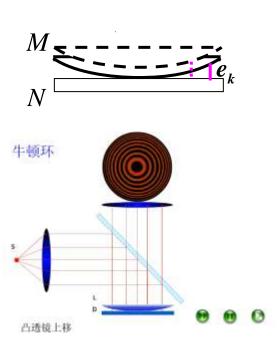
$$\delta = 2ne + \lambda/2 = k\lambda$$

e增大:

圆形条纹向内收缩 向中心湮灭

e减小:

圆形条纹向外扩张 从中心冒出



中心处明暗交替变化

明环:
$$r_k = \sqrt{\frac{(2k-1)\lambda R}{2n_2}}$$
 暗环: $r_k = \sqrt{kR\lambda/n_2}$

- 测光波波长
- 测透镜球面镜半径
- 检查光学仪器表面质量
- 研究机械零件内应力的分布

应用1: 测量光波波长

光垂直照射空气中的牛顿环,借助于显微镜测得由中心往外数第k级明环半径 $r_k = 3 \times 10^{-3} \text{m}$,从k级往外数第16个明环半径为 $r_{k+16} = 5 \times 10^{-3} \text{m}$,平凸透镜的曲率半径为 R = 2.5 m。试求该光的波长。

解: 由明环半径公式

$$r_{k} = \sqrt{(2k-1)R\frac{\lambda}{2}} \quad r_{k+16} = \sqrt{[2\cdot(k+16)-1]R\frac{\lambda}{2}}$$

$$r_{k+16}^{2} - r_{k}^{2} = 16R\lambda$$

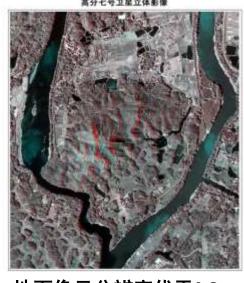
$$\lambda = \frac{(5\times10^{-3})^{2} - (3\times10^{-3})^{2}}{16\times2.50} = 4\times10^{-7} \,\mathrm{m}$$

应用2: 测量透镜球面曲率半径





高分七号卫星立体影像



地面像元分辨率优于0.8m, 能获取5谱段高空间分辨率 立体测绘遥感数据。

2020年免费开放高分1号6号卫星的16米全球数据。

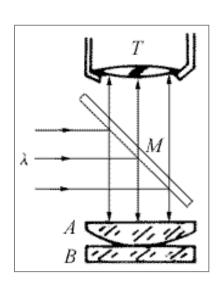
观察牛顿环的装置如图所示。波长 $\lambda=589$ nm的钠光平行光束,经部分反透平面镜M反射后,垂直入射到牛顿环装置上。今用读数显微镜T观察牛顿环,测得第k级暗环半径 $r_k=4.00$ mm,第k+5级暗环半径 $r_{k+5}=6.00$ mm。求平凸透镜A的球面曲率半径R。

解:为空气薄膜牛顿环,折射率n=1

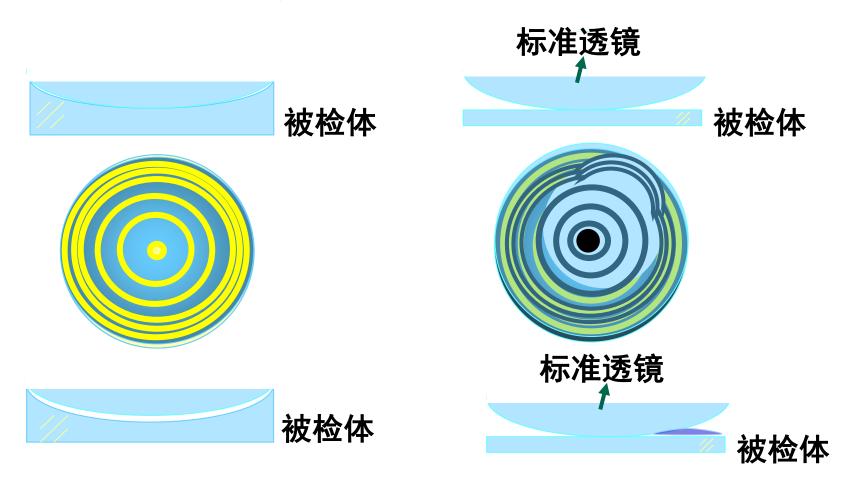
$$r_{k} = \sqrt{kR\lambda} \qquad r_{k+5} = \sqrt{(k+5)R\lambda}$$

$$R = \frac{r_{k+5}^{2} - r_{k}^{2}}{5\lambda}$$

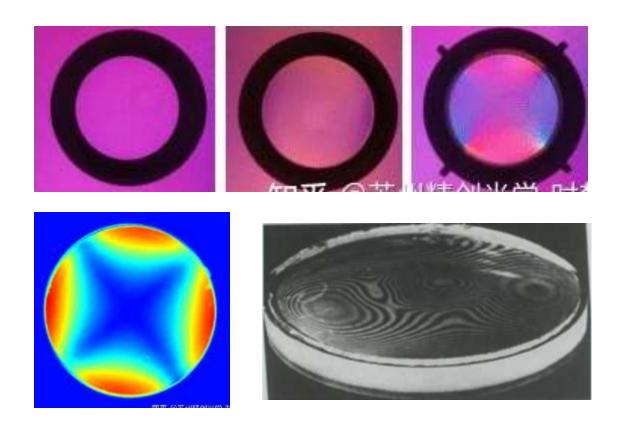
$$= \frac{(6.00^{2} - 4.00^{2}) \times 10^{-6}}{5 \times 589 \times 10^{-9}} = 6.79 \text{(m)}$$



应用3:检查光学仪器样品表面质量

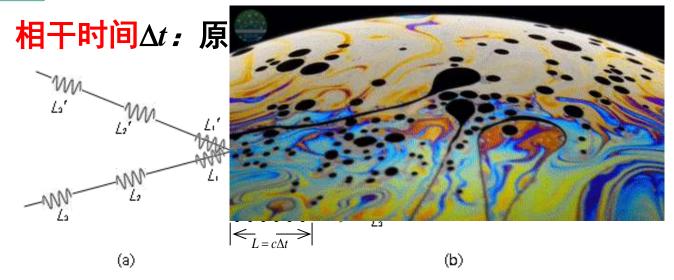


应用4: 研究机械零件内应力的分布



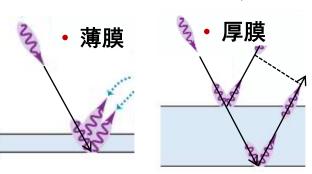
讨论

为什么要强调"薄膜"干涉?



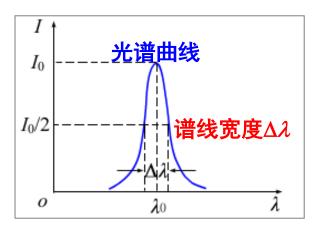
相干长度:光波列能相干的最大光程差,可视为

一个光波列长度。



1010101001011011011011E=mc20

相干长度与谱线宽度之间的关系: $L = \delta_m = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$



光源	中心波长λ0	谱线宽度∆λ	相干长度L
太阳光	550nm	~ 300nm	1μm
钠光灯	589.3nm	~ 0.6nm	0.6mm
氦氖激光器	632.8nm	< 10 ⁻⁹ nm	400km

光源的时间相干性

01001011011011011E=mc2

作业: